AIN CERAMIC HEATER AND MANUFACTURE THEREOF										
Patent Number:	JP4324276									
Publication date:	1992-11-13									
Inventor(s):	UDAGAWA ETSURO; others: 03									
Applicant(s):	KAWASAKI STEEL CORP									
Requested Patent:	□ <u>JP4324276</u>									
Application	JP19910094355 19910424									
Priority Number(s):										
IPC Classification:	H05B3/20; C04B35/58; H05B3/14; H05K1/03;									
EC Classification:										
Equivalents:										
Abstract										
PURPOSE:To manufacture a ceramic heater of which both surfaces are flat and without protruding an electrode part by contriving uniformity of temperature distribution in a base unit of the ceramic heater, internally furnished with a heating resistor by laminating an AIN substrate, utilizing bear holes as a method of taking out the electrode part to the outside and providing a notch in a brazing part of the electrode part to an external wiring.  CONSTITUTION:The first layer substrate 1 has a heating resistor 6 and a terminal 7 in an upper total surface of a ceramic substrate 5. In the second layer substrate 2 has a heating resistor 9 in a peripheral edge part in an upper surface of a ceramic substrate 8. The third layer substrate 3 has vertical through viaholes 13 in a ceramic substrate 12. In the fourth layer substrate 4, the terminal 7 of the first layer substrate 1, having a notch 15, is provided in a position opposed to a beer hole 10 of the second layer substrate 2. A terminal 11 of the second layer substrate 2 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3. The notch 15 of the fourth layer substrate 4 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3.										
Data supplied from the esp@cenet database - I2										

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-324276

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

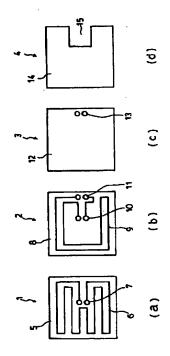
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号		庁内整理番号		FI	技術表示箇所				
H05B	3/20	393		7913-3K							
C 0 4 B	35/58	104	Y	8821-4G							
H05B	3/14		В	8715-3K							
H05K	1/03		Н	7011-4E	•						
110 011	1/09		В	8727-4E						•	
	27 00						審査請求	未請求	請求	マダイ(全 5 頁)	
(21)出願番号		<b></b>	5			(71)出願人	0000012	258			
							川崎製鋼	<b>扶株式会</b>	灶		
(22)出願日		平成3年(1991)4月24日				兵庫県神	兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28				
		,					号				
						(72)発明者	宇田川	悦郎			
							千葉市川	川崎町1	番地	川崎製鉄株式会社技	
							術研究2	本部内			
						(72)発明者	計 村 直	美			
							千葉市川	川崎町1:	番地	川崎製鉄株式会社技	
							術研究	本部内			
						(74)代理人	<b>弁理士</b>	小杉	佳男	(外1名)	
										最終頁に続く	

## (54) 【発明の名称】 A1Nセラミツクヒータ及びその製造方法

## (57)【要約】

【目的】A1N基板を積層して発熱抵抗体を内装させたセラミックヒータの基体内の温度分布の均一化を図る。また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホールを利用し、電極部と外部配線とのろう付け部に切欠を設けることによって、電極部が突出しない、両面が平坦なセラミックヒータを製造する。

【構成】第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に 発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に発熱抵抗体9を有する。第 3層基板3はセラミック基板12に上下貫通ピアホール 13を有する。第4層基板4は切欠15を有する第1層 基板1の端子7は、第2層基板2のピアホール10対向 する位置に設けられている。第2層基板2の端子11 は、第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設 けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の上面に発熱抵抗体を設け、その上 にピアホール電極を有する基板及び該電極部に対応する 切欠を有する最上層基板を積層してなることを特徴とす るAINセラミックヒータ。

【請求項2】 上面に発熱抵抗体を設けた基板が複数の 積層体であり、該基板上の発熱抵抗体を結合する導通ビ アホールを有することを特徴とする請求項1記載のA1 Nセラミックヒータ。

【請求項3】 基板が熱伝導率160W/m・K以上の 10 AlN質焼結体であり、発熱抵抗体がW-AlNの複合 焼結体からなり10-3Ω・cm以下の室温時の電気抵抗 率及び正の抵抗温度係数を有することを特徴とする請求 項1又は2記載のAINセラミックヒータ。

【請求項4】 厚膜印刷法によって発熱抵抗体を形成 し、該発熱抵抗体をグリーンシート積層法によりセラミ ック基体中に埋設することを特徴とする請求項1、2又 は3記載のAINセラミックヒータの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家庭用機器、電子機 器、産業用機器、及び自動車等に利用されるセラミック ヒータ及びその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】これまでにセラミックスを基体とするヒ **ータとしては、W(タングステン)-アルミナ系、ある** いはMo (モリブデン) -アルミナ系において実用化が 図られており、多くの製品がでている。このようなアル ミナ系におけるセラミックヒータは基体が電気的、化学 的に安定であるばかりでなく、発熱抵抗体の電気的特 30 性、熱的特性に関して設計上に多くの利点を有する。

【0003】しかし、アルミナは熱膨張が大きく、熱伝 導が悪いことから急激な温度変化に弱く、耐熱衝撃温度 が150~250℃と低い。さらに、熱伝導性に劣るこ とから、プレート状の基体の場合には、通電時に発熱部 とプレート周辺部の温度差が大きくなりやすく、被加熱 物に対する熱伝達効率が低いといった問題がある。ま た、家庭用機器、電子機器、産業用機器及び自動車用と 広く用いられいているセラミックヒータ一般に対し、

- 設定の温度への到達時間の短縮 (1)
- 熱サイクル及び電圧印加サイクルにおける、電 (2) 気的、機械的信頼性の向上
- (3) 熱伝達効率の向上
- (4) 使用環境に対する耐性の向上

などの要求が高まってきている。このような要求に対 し、アルミナを基体とした既存のセラミックヒータでは 十分に応えられなくなっている。

【0004】そこで、従来のアルミナに代る基体とし て、窒化アルミニウム(AIN)又は窒化ケイ素などの に優るだけでなく、特に、AlNは熱膨張が小さい上 に、熱伝導率がアルミナの10倍程度もあることなどか。 ら、新しいセラミックヒータ用の基体として有望視され ている。

2

【0005】しかし、A1Nはアルミナと比べ単身でも 焼結が難しく、発熱抵抗体を内蔵したものはいまだに実 現していない。これはA1Nの焼成が一般には1800 ℃以上という高温でなされることと、脱脂及び窒素不雰 囲気でなされることが原因で、A1Nと同時に焼成でき る材料が限られているためである。これまでに、AIN と同時に焼成できる材料としてWやMoをはじめとする 高融点金属を用いた開発が進められてきたが、AlNと の焼結性の一致をはかりながら所望の物性値を得ること が困難であった。

【0006】また、発熱抵抗体のパターンをセラミック 焼結体内に形成する方法も、単純なものに限られてお り、このためプレート状の基体表面での温度分布が不均 一となったりする場合が多い。

## [0007]

20

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来からあ るセラミックシートの積層技術と厚膜印刷技術、さらに はスルーホールメタライズ技術を用いて、発熱抵抗体を 内蔵したセラミックヒータを開発するにあたり、プレー ト状の基体内の温度分布の均一化を図ることを目的とす る。また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホール を利用する技術、さらには電極部と二クロム線等の外部 配線との基体中におけるろう付け部に切欠を設けること によって、電極部が突出しない、すなわち両面が平坦な セラミックヒータを製造する技術を提供する。

### [8000]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板の上面に 発熱抵抗体を設け、その上にピアホール電極を有する基 板及び該電極部に対応する切欠を有する最上層基板を積 層してなることを特徴とするA1Nセラミックヒータで ある。この場合、上記上面に発熱抵抗体を設けた基板を 複数の積層体とし、これらの基板上の発熱抵抗体を導通 ピアホールで結合すると好適である。

【0009】また、本発明のAINセラミックヒータは その好ましい実施態様として、基板が熱伝導率160W /m・K以上のAlN質焼結体であり、発熟抵抗体はW -A1Nの複合焼結体からなり室温時の電気低効率が1 0-0 Ω·cm以下でかつ抵抗温度係数が正であるセラミ ックヒータを提供する。また、上記のようなセラミック ヒータの製造方法としては、厚膜印刷法によって発熱抵 抗体を形成し、グリーンシート積層法によって発熱抵抗 体をセラミック基体中に埋設する。

#### [0010]

【作用】本発明は、AINを基体としたセラミックヒー タであって、内蔵された発熱抵抗体として、W、Wの酸 セラミックスが注目されている。これらは機械的な強度 50 化物、あるいはWの酸化物からの変成物よりなる少なく

3

とも1種類以上の主成分と、基体となるAINとの複合 焼結体を用いる。本発明はこのような場合のセラミック ヒータ基体の構造及び発熱抵抗体のパターンの配列、並 びに電極の外部への取り出し構造を改善したものであ ス

【0011】本発明は次の作用を生じる。

- (1) ヒータパターンを積層し、3次元配線とすることによって、熱密度を向上させる。
- (2) 基体内の温度分布が均一化する。
- (3) 積層方向の導通はピアホールを用いることによ 10 って、端子を基体外部へ露出させない。

【0012】(4) 最上層基板は切欠を設けた構造により、立体的な基体とし、外部電極部の突出部をなくし、両面が平坦となるようにする。

[0013]

【実施例】図1、図2に、本発明の実施例の説明図を示した。実施例は4層積層体である。第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に発熱抵抗体9を有する。第3層基板3はセラミック基板12に上下貫通ピアホール13を有する。第4層基板4は切欠15を有する第1層基板1の端子7は、第2層基板2のピアホール10対向する位置に設けられている。第2層基板2の端子11は、第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。

【0014】次に実施例の製造方法を説明する。平均粒径 $1.2\mu$ mのA1N粉末(酸素含有量0.65重量%、カーボン含有量0.02重量%)に、平均粒径 $0.5\mu$ mの $Y_2$   $O_3$  を2.5重量%を添加し、ポリピニルプチラール(PVB)を適量加えA1Nスラリーとした。このスラリーより、ドクタープレード法にて厚さ約1mmのグリーンシートを成形し、さらに $65 \times 65$ mm角に打ち抜き加工した。

【0015】外形加工の後、図1に示すように、グリーンシートのピアホール10、13の位置にスルーホールを形成し、さらに切欠15を打ち抜いた。引き続き、W粉末(平均粒径1.3 μm)、WOs粉末(10 μm)を重量比で3:1となるように配合したのちシートと同じA1N粉末を体積比で1:1となるように加え、エタノールを溶媒として用い、アルミナポールによる湿式のミリングを12時間行った。引き続き有機結合剤としてPMMA(ポリメチル・メタ・アクリレート)と、酢酸プチルを適量加え12時間のミリングを行った後、テレビネオールを適量加えて粘度を調整し、三本ロールミルを通し、印刷用ペーストとした。

【 $0\ 0\ 1\ 6$ 】 このペーストを $A\ 1\ N$ グリーンシート上に スクリーンマスクを用い厚さ約 $1\ 5\ \mu$ mのヒータパターン (図1に示す発熱抵抗体 $6\ .9$ )を形成した。またス 50

ルーホール10、13にも同様にベーストを充填した。 乾燥後、荷重400kg/cm²、温度130℃で図2 に示すように、積層した。ついで、1.6 tのCIP (冷間等方プレス)をかけた。

【0017】積層体を湿潤水素( $N_2-8%H_2$ ) 雰囲気で、600%、8時間の脱脂を行った。引き続き、窒素雰囲気中で<math>1840%、6時間の焼成を行い図3に示す焼結体<math>20を得た。ピアホール13の露出部にN1-Bメッキを施して電極とし二クロム線16をろう付けした。焼結体20は、基板 $1\sim4$ の積層体である。同種の積層体をアルミナを基板として製造し、比較例とした。

【0018】実施例及び比較例について通電試験(約5 秒で800℃となるように100Vを印加)を行い、プ レート状基体の温度分布をサーモビューアにより観察し た。100V印加1秒後の温度分布及び5秒後の定常状 態における観察結果を図4~図7に示した。図4は実施 例の上面、図5は実施例の下面を示し、それぞれ100 V印加1秒後(a)に示すように、200℃のリング状 の領域21と、250℃のコア領域22が観察され、5 秒後には(b)に示すように800℃の一様な加熱域2 3が観察された。図6は比較例の上面、図7比較例の下 面を示し、それぞれ100V印加1秒後(a)に示すよ うに、150℃の領域24と島状の領域25とを生じ、 5 秒後に(b)に示すように800℃の定常状態におい ても700℃の周縁領域26、750℃の中央領域2 7、800℃の電極近傍領域28を生じ、一様な加熱状 態とならなかった。

[0019]

【発明の効果】以上に述べたように本発明によると、基 の 体にAINを用い、プレート内の温度分布の均一性が著 しく向上したセラミックヒータを実現することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の4枚の基板の平面図である。

【図 2】 実施例のセラミックヒータの積層構造を示す斜 視図である。

【図3】実施例のセラミックスヒータの(a)平面図、

(b) 側面図である。

【図4】サーモビュアによる実施例の観察面の説明図である。

【図 5】 サーモビュアによる実施例の観察面の説明図である。

【図 6】 サーモビュアによる比較例の観察面の説明図で あみ

【図7】サーモビュアによる比較例の観察面の説明図である。

【符号の説明】

1, 2, 3, 4 基板

5, 8, 12, 14 セラミック基板

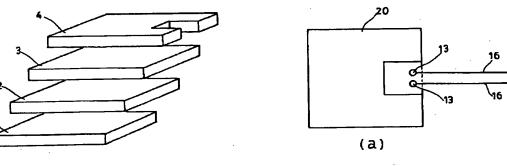
6,9 発熱抵抗体

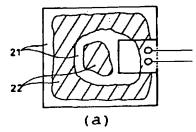
7, 11 章 10, 13 15 切欠 ピアホール

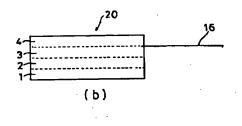
16 ニクロム線 焼結体 20

[図1] (d) (c) (b) (a)

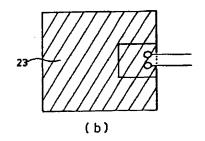
[図2] 【図4】

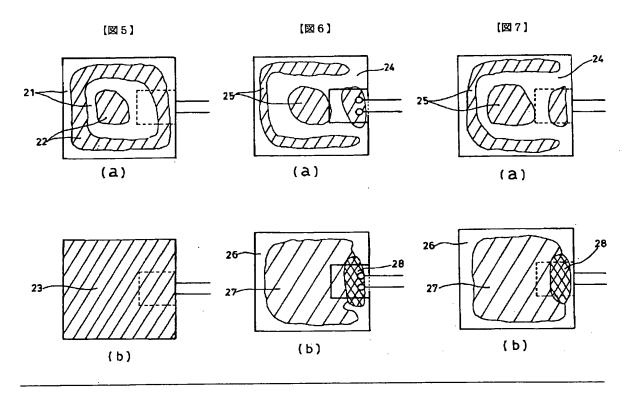






【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 前田 榮造

千葉市川崎町 1 番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内 (72)発明者 熊谷 正人

千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内